

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年7月10日(2014.7.10)

【公表番号】特表2013-541845(P2013-541845A)

【公表日】平成25年11月14日(2013.11.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-062

【出願番号】特願2013-531767(P2013-531767)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 03 F 7/40 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 7 0

G 03 F 7/40 5 1 1

【手続補正書】

【提出日】平成26年5月21日(2014.5.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0052

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0052】

本明細書では、パターニングレジストの粗さを改善する新規性および進歩性を持つ方法を開示している。本開示の範囲は、本明細書で説明した具体的な実施形態に限定されるものではない。本開示の他のさまざまな実施形態および本開示の変形例は、上述の説明および添付図面を参照すれば、本明細書で説明したもの以外にも存在することが当業者には明らかであろう。例えば、上述した本発明の実施形態は概してArイオンを衝突させているが、本発明は他のイオン種でも実施可能である。このため、このような他の実施形態および変形例は、本開示の範囲に含まれるとする。さらに、本開示は特定の目的を実現するべく特定の環境で特定の方法で実施されるものとして本明細書で説明したが、当業者であれば、本開示の有用性はこれらに限定されることなく、本開示は任意の目的を実現するべく任意の環境で実施しても有益であることを認めるであろう。したがって、特許請求の範囲に記載する請求項は、本明細書で説明しているように、本開示の全範囲およびあらゆる意図を鑑みて、解釈されたい。。